# 科学研究費助成事業

研究成果報告書



平成 26 年 5月 12日現在

機関番号: 1 1 3 0 1
研究種目: 若手研究(A)
研究期間: 2010~2013
課題番号: 2 2 6 8 6 0 0 1
研究課題名(和文)1000%以上の磁気抵抗比を有する二重トンネル接合素子の磁気抵抗メカニズムの解明
研究課題名(英文)Investigation of large tunnel magnetoresistance of 1000% in double tunnel junctions
研究代表者
永沼 博(Naganuma, Hiroshi)
東北大学・工学(系)研究科(研究院)・助教
研究者番号:60434023
交付決定額(研究期間全体):(直接経費)  19,900,000円 、(間接経費)  5,970,000円

研究成果の概要(和文):二重トンネル接合素子の磁気抵抗効果について明らかにするためにゲートバイアス電圧依存 性および界面の極微構造について系統的な調査を行った。ゲートバイアスはトンネル接合部位の横方向から印加できる 素子を新たに作製した。その結果、ゲートバイアス電圧によりクーロンブロッケードが変調できている可能性が示唆さ れる結果を得た。しかし、その変調効果は弱く、ゲート間距離を短くしてバイアス効果を高める必要があることがわか った。また、高分解電子顕微鏡観察から原子拡散と歪みが印加されていることがわかった。本研究によりゲート変調に よる磁気抵抗比の増大は得られたものの増大量は理論予測よりかなり低いことがわかった。

研究成果の概要(英文):Gate bias voltage dependence and systematic investigation of microscopic structure at the interface was carried out in order to clarify the magnetoresistance effect of the double magnetic tunnel junctions (DBMTJs). Gate bias was made a noble element by the side-gate system in the DBMTJs. As a result,Coulomb blockade tunneling was modulated by the side-gate bias voltage. However, the modulation eff ect is weak, and it was found that it is necessary to increase the bias voltage effect by decreasing the d istance between the two side-gates. Further, atomic diffusion and strain was observed by high resolution t ransmission electron microscopy observation. Increase of the magnetoresistance ratio due to gate modulatio n was obtained by the present study; however, the enhancement was found to be significantly lower than the theoretical prediction.

研究分野:工学

科研費の分科・細目:応用物理学・工学基礎・応用物性・結晶工学

キーワード:磁気抵抗 トンネル素子 MgO障壁

#### 1.研究開始当初の背景

スピントロニクスの分野では、磁気ヘッドの高感 度化および不揮発性磁気メモリのスピン注入効 率を高めるために高い磁気抵抗比を得ることが 必要となっている。これまでにハーフメタルのホ イスラ 合金、LaSrMnO。ペロブスカイト酸化物 などを強磁性電極として、MgO を障壁層としたト ンネル接合素子において高い磁気抵抗比が報 告されている。しかし、従来型の強磁性電極の 二枚を MaO 障壁で挟んだトンネル磁気抵抗素 子では磁気抵抗比の増大には限界が見えてお り、従来型の磁気抵抗素子とは異なる新しいメカ ニズムによる磁気抵抗比の増大を戦略的に検 討する必要性もある。また、新しい革新的な機構 としてトンネル磁気抵抗効果をゲートバイアスで 制御したスピントランジスタの創製など新しい出 バイアスの創出がスピントロニクスの分野では望 まれている背景がある。トンネル障壁を2つ有し た二重トンネル接合素子においては、中間の強 磁性層が連続膜の場合において共鳴トンネル 効果、強磁性層がナノ粒子状態となっているとき はクーロンブロッケード効果が現れることが理論 的に予測され、高い磁気抵抗比が得られること が期待されている。実験としては一部、現象は 確認されているが高い磁気抵抗比を得るまでに は至っていない。二重障壁強磁性トンネル接合 素子をベースとして高い磁気抵抗効果およびト ンネル伝導をゲートバイアスにより制御すること により高スピン分極電流を自由に制御できること が期待されている。しかし、二重障壁強磁性トン ネル接合素子のトンネル伝導にバイアス電圧を 印加するためには、膜厚および界面構造を高度 に制御した製膜技術、高度で複雑な微細加工 技術の双方が必要となるため、これまで殆ど研 究が行われてこなかった。

#### 2.研究の目的

本研究課題では高い磁気抵抗効果が期待さ れている二重トンネル接合素子を作製し、ト ンネル電子にゲートバイアス電圧を印加さ せるために、接合部位の横方向から電圧を印 加する構造を作製して、スピン依存のトンネ ル伝導を制御することを試みた。

## 3.研究の方法

二重トンネル接合素子用の多層膜は超高真空 下まで排気したチャンバーにおいて、マグネトロ ンスパッタ法で作製した。基板には熱酸化膜付 き Si 基板を用いた。 試料の多層構造は次のとお りである。IrMn (6.0)/ Co75Fe25 (2.0)/ Ru (0.8)/ CFB (2.0)/ MgO (2.5)/ island-shaped CFB (t =0.6, 1.0, 1.2)/ MgO (3.2)/ CFB (2.0)/ Ru(0.8)/ Co75Fe25(3.0)/ IrMn (8.0)。[数字は nm 単位] 試料の微細加工には Photo リソグラフィー法と電 子線リソグラフィー法を併せて用い、複数回の加 工を経てゲートバイアスを横方法へ印加できる 素子を作製した。バイアス電圧は独立に印加で きるような引き出し電極パッドを設けている。試 料の構造は X 線回折実験、 透過型電子顕微鏡 観察実験、原子間力顕微鏡、走査型電子顕微 鏡(SEM)により包括的に評価した。磁気特性は 振動試料型磁力計および超電導量子干渉計に より評価した。トンネル伝導および磁気抵抗効果 を直流四端子法により評価した。測定は6Kから 室温の間で行った。

### 4.研究成果

図 1 にトンネル接合部とバイアス電圧印加部の 平面 SEM 写真を示す。トンネル接合のサイズは 100 nm 程度でゲートバイアス電圧を印加するた めの電極パッドが精度高くトンネル接合素子へ 配置されていることがわかる。パッドおよびトンネ ル接合の部分についてはトポレジストをもちいて 電子線リソグラフィーにより作製した。(レジストの 種類、電子線描画の条件の最適化を行っている が、本報告では割愛する)



図 1 電子線リソグラフィーにより作製した トンネル接合部と、それに平行に配置された バイアス電圧用電極パッド

次に、トンネル接合の中間層にクーロンブロッケ ード伝導をもたらすため、ナノ粒子になるための 成膜条件を最適化した。平均粒子サイズは磁化 曲線をフィットすることにより算出した。図2に中 間層の設計膜厚を変化させたときの磁化曲線を 示す。尚、中間層は設計膜厚が1.5 nm以下のと き、連続膜から分断された粒子状になった。磁 化曲線から算出した粒子分布から、設計膜厚の 低下と共にナノ粒子が微小化していることがわ かり、中間層だけナノ粒子化させることに成 功した。横方向のゲート電圧の印加できる二 重障壁強磁性トンネル接合素子の磁気抵抗 効果を示す。図3に6Kと300Kで測定した 磁気抵抗曲線を示す。この磁気抵抗曲線は横





図 2 二重トンネル接合素子の中間層の設計 膜厚を変化させたときの磁化曲線および磁 化曲線から見積もった粒形分布



図3300 Kおよび6 K で測定した二重障壁強 磁性トンネル接合素子の磁気抵抗曲線

方向のバイアス電圧を印加せずに測定した。6 Kおよび300Kのいずれにおいても磁気抵抗効 果が観測され、低温では最大で60%程度を得る ことに成功した。これは、以前のF. Ernultらの報 告と比べても高い磁気抵抗比となる。これは、本 研究で作製した多層構造の界面が制御されて いることが示唆された。

ナノ粒子化した中間層へのスピン電流のクー ロンブロッケード現象を確認するため、電流のバ イアス電圧依存性およびトンネル磁気抵抗比の バイアス電圧依存性を調べた[図 4]。測定は比 較的高い磁気抵抗比が得られた6Kで行った。 図 4(a)の赤および青のデータ線は固定層の磁 化の平行および反平行状態をあらわす。図 4(b)



図46Kで測定した電流およびトンネル磁気 抵抗比のバイアス電圧依存性。バイアス電圧 は垂直方向へ印加した。

は磁化の平行・反平行から算出した磁気抵抗比 である。低バイアス領域において明瞭な磁気抵 抗比の振動現象が観測されており、クーロンブ ロッケード現象が二重障壁強磁性トンネル接合 のナノ粒子化した中間層で起こっていることが確 認された。

最後にトンネル接合部へ横方向にバイアス電 圧を印加した実験を行った。その結果、僅かな がら磁気抵抗曲線の形状に変化がもたらされて おり、トンネル伝導が制御できていることが示唆 された。しかし、その変化はかなり小さく、より効 率的にバイアス電圧を印加させる必要があること がわかった。そのためには、電極パッドとトンネ ル接合素子の距離を近づけて電界の低減させ ない工夫が必要である。簡易的な計算によると、 いまの横方向に配置した電極パッドは100 nm以 上となっているが、その距離を50 nm 以下にまで 近づけることによりバイアス電圧の効率が効果的 に印加できることがわかった。電子線リソグラフィ ーにおいて、チップマークからの電子線の移動 量を減らすこと、レジストの電子線に対する感度 の分散を低減することなど、微細加工技術をさら に高度かすることが課題として明らかとなった。 以上のように本課題では量子化されたスピン依 存伝導を制御することにより高いスピン分極電 流を制御することを試みた革新的な研究であり、 スピン依存伝導の制御に関わる初見の成果を 得るとことまで到達することに成功した。また、研 究を発展させるための実験の技術的な課題も明 確化されている。

5.主な発表論文等 (研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

〔雑誌論文〕(計4件)

1. N. Tal, D. Mogilyanski, Andras Kovacs, <u>Hiroshi Naganuma</u>, Sumito Tsunegi, Mikihiko Oogane, Yasuo Ando, and Amit Kohn, Journal of Applied Physics, 査読有 114 巻, 2013, 163904

DOI: http://dx.doi.org/10.1063/1.4826908

2. Kosuke Fujiwara, Mikihiko Oogane, Saeko Yokota, Takuo Nishikawa, <u>Hiroshi Naganuma</u>, and Yasuo Ando, Fabrication of magnetic tunnel junctions with a bottom synthetic antiferro-coupled free layers for high sensitive magnetic field sensor devices, Journal of Applied Physics, 査読有 111 巻, 2012, 07C710.

DOI: 10.1063/1.3677266

3. W. X. Wang, Y. Yang, <u>Hiroshi Naganuma</u>, Yasuo Ando, R. C. Yu, and X. F. Han, The perpendicular anisotropy of  $Co_{40}Fe_{40}B_{20}$ sandwiched between Ta and MgO layers and its application in CoFeB/MgO/CoFeB tunnel junction, Applied Physics Letters, 査読有 99 巻, 2011, 012502.

DOI: 10.1063/1.3605564

4. L. X. Jiang, <u>Hiroshi Naganuma</u>, Mikihiko Oogane, Kosuke Fujiwara, <u>Takamichi Miyazaki</u>, Kazuhisa Sato, T. J. Konno, Shigemi Mizukami, and Yasuo Ando, Magnetotransport properties of CoFeB/MgO/CoFe/MgO/CoFeB double barrier magnetic tunnel junctions with large negative magnetoresistance at room temperature, Journal of Physics: Conference Series, 査読有 200 巻, 2010, 052009. DOI:10.1088/1742-6596/200/5/052009

[学会発表](計12件)

- H. Liu, D. Li, P. Guo, Y. Yang, S. Sakul, <u>Hiroshi Naganuma</u>, R. Yu, and X. F. Han "Temperature dependence of tunneling conductance in the perpendicular anisotropy CoFeB/MgO/CoFeB magnetic tunnel junctions" 12th Joint Magnetism and Magnetic Materials/Intermag Conference, Chicago USA 2013 年 1 月 15 日
- Tian Yu, <u>Hiroshi Naganuma</u>, D. Shi, Yasuo Ando and X. Han "Magnetic properties and magnetic domain structures evolution modulated by CoFeB layer thickness in [Co/Pd]/CoFeB/MgO/CoFeB/[Co/Pd] perpendicular MTJ films" International conference on magnetism, Vancouver Canada, 2012 年 5 月 8 日
- 3. Thamrongsin S., <u>Hiroshi Naganuma</u>, Mikihiko Oogane, and Yasuo Ando"Fabrication of the

 $Co_{40}Fe_{40}B_{20}$  double magnetic tunnel junction with lateral electric field controlled spin transport" the 59th Spring Meeting, 2012, The Japan Society of Applied Physics, 早稲田 大学, 2012 年 3 月 16 日

- 4. 安藤 康夫, <u>永沼 博</u>, 大兼 幹彦 "二重強 磁性トンネル接合の磁気抵抗効"第34回日 本磁気学会学術講演会,つくば国際会議場, 2010年9月4日
- 5. 安藤 康夫,<u>永沼 博</u>,大兼 幹彦 "二重強 磁性トンネル接合の磁気抵抗効果"応用物 理学会、第 71 回応用物理学会学術講演会, 長崎大学 2010年9月14日

〔図書〕(計0件)

〔産業財産権〕 出願状況(計0件)

名称: 発明者: 権利者: 種類: 出願年月日: 国内外の別:

取得状況(計0件)

名称: 発明者: 権利者: 種類: 番号: 取得年月日: 国内外の別:

### 〔その他〕 ホームページ等

- 6 . 研究組織
- (1) 永沼 博(NAGANUMA HIROSHI)
  東北大学·大学院工学研究科·助教
  研究者番号:60434023

(2)研究分担者 なし

(3)連携研究者 宮崎 孝道(MIYAZAKI TAKAMICHI) 東北大学·大学院工学研究科·技術職員 研究者番号:20422090